

2022 年 11 月 2 日

経済産業大臣

西 村 康 稔 殿

一般社団法人日本半導体製造装置協会

会 長 牛 田 一 雄

税制改正に関する要望書

2022 年 4～6 月期における日本の実質 GDP 速報値（2 次速報値）は年率換算で 3.5%増となり、新型コロナ禍の影響はまだ残るものの、民間設備投資の力強さを感じさせるものとなりました。10 月発表の IMF 世界経済見通しでは、2022 年の世界実質成長率は合計値で 3.2%と 7 月予測時と同等でしたが、2023 年の合計値は 2.7%と 0.2 ポイント引き下げられました。ウクライナ戦争長期化やエネルギー価格の高騰、利上げの継続や世界的なインフレ傾向が景気に与える影響が色濃く反映された数字となっています。国際的な税制面では、既に OECD 加盟国など日本を含めた世界約 130 カ国・地域が 2023 年中に法人税の最低税率を 15%にすることで合意しており、各国でそれらに向けた準備が進められています。世界の巨大 IT 企業を取り巻く環境も大きく変わろうとしております。

半導体は、デジタル社会を支える重要基盤・安全保障に直結する戦略技術として認識され、各国間の競争も更に峻烈さを極めております。既に米国、中国、韓国、台湾、欧州の各国地域は、経済安全保障の観点から半導体産業を重視し、過去にないレベルの産業政策を展開しております。これらには、半導体製品の競争力強化だけでなく、自国の半導体製造装置の競争力強化と内製化率を高める動きが含まれています。

現在日本製半導体・FPD 製造装置の世界シェアは 3 割程度を維持しており、殆ど国内に生産拠点を有し、国内の雇用を維持しながら、輸出比率 8 割を達成しております。昨年度の日本半導体製造装置の販売高は、前年同期比 44.4%増と高い伸びを記録しましたが、世界シェアとしては 29.4%（2021 年 FY 世界販売額 \$=¥113 換算に対して）と 2 年連続して 3 割を割込む水準となりました。

当業界は技術革新が著しい産業であり、これからも日本企業がグローバル競争に打ち勝つためには、絶え間ない最先端技術の研究・開発によるイノベーションの創出が必要不可欠です。現在、日本の半導体・FPD 製造装置メーカーの売上高比研究開発費は平均して 8.4%程度となっております。日本の製造業の中では相対的に高い水準ですが、世界的な半導体製造装置企業に比較すると、明らかに見劣りしているのが実情です。

ロジック半導体を例にとると、既に 2037 年に至る技術ロードマップが示されております。今後共トランジスタの構造と使われる材料が大きく変化してゆく見込みです。世界中の半導体製造装置メーカーが、その構造と材料の変化に合わせて、高度な開発

を行っています。半導体産業は、今まさに技術の変曲点を迎えており、研究開発費につきましては、ここ数年で更なる上昇が予想されております。技術の大きな変化タイミングでは、持続的に高い先行開発費を負担できるかどうか、企業の産業競争力を決定します。

今こそ半導体製造装置業界には、税制面を中心として持続的な研究開発費の先行負担に見合った手厚い政策サポートが必要です。国際競争力を保ち、国内に生産・開発拠点を維持することで雇用を増やし、重要技術を支えるサプライチェーンの更なる強化を進めてゆくためにも、以下に挙げた項目の税制改正を強く要望致します。

1. 研究開発促進税制の拡充と見直し

半導体・FPD 製造装置産業の売上高研究開発費率は 8.36%^{※1}と、全産業平均の 4.27%^{※2}、製造業平均の 5.48%^{※2}と比較して約 1.5 倍もの研究開発費を投じています。海外競合企業の売上高研究開発費率も 13.8%^{※3}となっており研究開発費比率が非常に高い産業と言えます。

こうした当産業における研究開発費の状況とその果たす役割を踏まえて、次の措置を要望します。

※1 当協会の 2022 年 9 月調査による SEAJ 会員企業主要 18 社の 2017～2021 年度の 5 年間の平均

※2 出所：経済産業省「2021 年企業活動基本調査確報（2020 年度実績）」

※3 当協会の 2022 年 9 月調査による海外競合企業主要 5 社の 2017～2021 年度の 5 年間の平均

(1) 半導体投資促進税制の導入

昨今の半導体製造装置を含む半導体業界を取り巻く環境は、安全保障上の問題を背景として、当産業の重要性を強く意識した優遇制度が前例の無い規模で世界各国において打ち出されている状況にあります。国を挙げて後押しを受ける諸外国企業との競争は熾烈さを極めており、本国企業が国際競争を勝ち抜くには、諸外国企業と同等の税制面での後押しが必要不可欠であり重要な前提となりつつあります。また当産業における本国企業の優位性は、各社固有の強みだけにあるのではなく、国内における高い技術力を持った関連分野の企業の多さにも起因するため、半導体産業全体の発展と強化を図ることが重要になります。

当産業において本国企業が引き続き競争力を発揮するには設備投資を積極的に行うことが欠かせないため、つきましては当産業における設備投資について概ね 20%程度の税額控除が可能となる新たな優遇制度を要望します。

さらに当産業における研究開発は、国際競争力の源泉であるだけでなく国の成長を根底から支える重要な投資でもあるため、つきましては当産業における研究開発に関して、研究開発費の増加割合に対してではなく研究開発費の総額に対して概ね 40%から 50%程度の税額控除が可能となる新たな優遇制度を要望します。また控除限度額がキャップとなることがないよう、控除限度額は設けないかまたは十分に緩和された控除限度額（例えば法人税額の 50%を超える限度額）で設定されたものとするか、もしくは最低税率を定め（例えば実効税率 15%程度）当最低税率に達す

るまでは税額控除が可能となる制度を要望します。

(2) 試験研究費の税額控除割合の拡大及び税額控除限度額の廃止

当産業の研究開発費が多額であること、それによってもたらされる産業全体の成長とイノベーションが国益にもたらす影響を踏まえ、現在の試験研究費の税額控除制度における税額控除割合の拡大と控除限度額の廃止を同時に実現することを要望します。当産業の税額控除限度額の切捨て額は127億円^{※4}にのぼり、これは当産業の法人税額1,616億円^{※5}の約8%に相当する額となります。

上記の通り、法人税額に対する税額控除の割合は十分な割合とは言えないため、さらなる税額控除割合の拡大並びに税額控除限度枠のさらなる引き上げ、更には限度枠の廃止を要望します。加えて、研究開発税制は成長戦略の重要な政策税制であるため、租税特別措置法による時限的措置ではなく、本来、本則化による恒久的措置とすべきと考えます。

※4 当協会の2022年9月調査によるSEAJ会員企業主要18社の2017～2021年度の5年間の平均

※5 当協会の2022年9月調査によるSEAJ会員企業主要18社の2017～2021年度の5年間の平均

(3) 繰越税額控除限度超過額等の繰越期間の復活及び繰越税額控除要件の廃止

当産業の業績は、顧客である半導体・FPDメーカーの急激な投資動向の変化による振れ幅が大きく、かつそのサイクルも長期にわたるケースが多くあります。平成27年度に廃止された試験研究費の税額控除制度におきましては、繰越税額控除限度超過額がある場合、一定期間に限ってのみ繰越控除が認められていましたが、廃止された現行制度下においては、超過額に対する恩恵を受けることができなくなっております。また、廃止前の制度の下であっても、当該事業年度に所得がないために本制度の恩恵を受けられないケースが生じておりました。

つきましては、まずは本制度の復活を要望します。加えて、諸外国の同制度が主に複数年～無期限であることに鑑み、繰越税額控除限度超過額等の繰越期間を無期限とし、併せて繰越控除を行う際の従来の控除要件は廃止することを要望します。

(4) サービス開発税制の拡充及び自社利用ソフトウェアの開発費用の扱いについて

サービス開発税制において、例えばセンサーの設置等を行う補助者の人件費に関しては税務上の試験研究費の対象範囲に含まれないとされておりますが、これらの作業は開発過程において必須であるケースが多いことを鑑み、補助者に係る人件費についても試験研究費の対象範囲に含めることとするよう要望します。

また、令和3年度税制改正において税務上の試験研究費の範囲が拡大され、自社利用目的のソフトウェアにかかる研究開発費についても税務上の試験研究費に含まれることとされましたが、一方かかる研究開発費の所得計算上の扱いは、従前通り資産計上が求められており、会計上の扱いと税務上の扱いに乖離が生じたままとなっております。税務上のみにフォーカスした場合でも、同一の研究開発費に対して税額控除計算上は試験研究費として認める一方で、所得計算上は資産計上が求め

られており疑問が残る制度設計となっております。この点について、所得計算上においても費用性を認めることとし、全体として整合のとれた税制となることを要望します。

(5) 特別試験研究費税額控除制度の適用要件の緩和

本税制の適用要件として、第三者による確認及び共同研究の相手方による確認が求められておりますが、これらの諸手続きに要する事務工数は想定以上に大きく、実態としても簡単な確認作業では終わらないケースが生じているため、適用要件の緩和もしくは撤廃を要望します。令和3年度版ガイドラインにて“むやみやたらと細かく事務処理を行う”ことへの注意コメントが追加されているものの、制度上、専門家への確認と確認書の提出を求めている点は変わらないため、その結果専門家がその後の税務調査も意識した確認と意見表明をする上ではある程度精緻な確認作業にならざるを得ず、実態としては事務工数の低下には繋がっていないと思われます。つきましてはこれらの状況を鑑み、適用要件の更なる見直しを要望します。

(6) イノベーションボックス税制の創設

研究開発の成果である特許などの知的財産に基づく所得を減税対象とするイノベーションボックス税制が欧州を中心に普及し始めています。

既に欧州においては、英国、オランダ、フランス等7カ国が、アジアにおいては中国がイノベーションの促進及び競争力向上を目的として、研究開発の成果である知的財産権から生じる所得に対する税率を優遇するイノベーションボックスまたはパテントボックス税制を導入しています。

一例として本税制を積極的に導入・推進するオランダでは、2004年に29.0%であった法人税率を2011年までに段階的に25.0%に引き下げる措置と併せて、2010年に従来のパテントボックス税制をイノベーションボックス税制へと拡大しています。オランダに限れば研究開発活動による知的財産から生じた所得のみならず、R&Dの機能に帰属する全ての所得に対してイノベーションボックス税制が適用される仕組みとなっており、更にこの適用を受けた場合に当該所得に適用される実効税率は9%と大変低い税率となるため、研究開発型の企業にとっては大変大きな恩恵を受ける税制が敷かれております。

同国に本社を置く半導体製造装置のメーカーであるASML社の2017年度から2021年度の法人税率は平均11.3%と極めて低く^{※6}、イノベーションボックス税制の恩恵を最大限受けております。

海外企業と同じビジネス環境で熾烈な競争を戦えるよう、わが国においてもイノベーションボックス税制をできる限り早期に導入することを要望します。

※6 ASML 社決算報告書による2017～2021年度の5年間の平均

2. 法人実効税率の引下げ

わが国の法人実効税率は、平成 28 年度税制改正により平成 27 年度の 33.06%から、平成 28 年度及び平成 29 年度は 30.86%、平成 30 年度以降は 30.62%へ引き下げられました^{※7}、依然として欧州及びアジア諸国に比べて高い水準にあります。

また、法人税率の引き下げが実施されている一方、平成 28 年度税制改正において地方税である外形標準課税は税率の引き上げが実施され、外形標準課税の割合が大きい企業や赤字企業等においては法人事業税が実質増税となる企業も少なからずあるのも事実です。

わが国と事業及び立地において競争関係にあるアジア諸国と比較すると、中国 25%、韓国 25%、台湾 20%、シンガポール 17%と 5～10%以上の乖離があり、日本の企業競争力及び立地競争力低下の大きな要因になっており、世界で戦う日本企業が継続的に存続することは困難です。

立地競争力強化のためには、空港・港湾等の産業インフラの整備、金融・資本市場の活性化、雇用制度の改革、人材強化等の総合的な施策が必要ですが、法人実効税率の引き下げの果たす役割は特に重要です。

従って、現在懸念されている「根こそぎ空洞化」を防止するに留まらず、より積極的に海外の成長力ある企業がわが国を拠点とした事業活動を行うことを希求する水準への思い切った引き下げが必要です。

具体的には、法人実効税率をアジア諸国と競争力のある水準である 20%前半まで、3 年以内に引き下げること及び外形標準の税率を改正前に戻すことを要望します。

※7 超過税率適用法人の場合（東京都の超過税率で算定した税率）

3. 欠損金の控除限度額の撤廃及び繰越期間の無期限化

法人税における繰越欠損金の控除制度は、単一年度課税の欠点を是正し、事業年度ごとの課税負担の平準化を通じて経営の中長期的な安定性を確保する上でも極めて重要な制度と考えています。

当半導体製造装置の産業の特徴として、顧客である半導体・FPD メーカーの投資動向の影響を受けやすく、景気後退期には大きな損失を計上する傾向があるため、繰越欠損金については十分な使用枠と繰越期間を設ける必要があります。

しかしながら、わが国の繰越欠損金に関する制度は、控除額は当期所得の 50%、繰越期間も 10 年と制限が課され、諸外国に比べても見劣りのする内容でグローバル企業と熾烈な競争を続ける上で国際競争力維持の観点からも障害となっております。

つきましては、繰越欠損金の控除限度額を撤廃した上で繰越期間を無期限とすることを要望致します。

4. 設備投資に関する減税及び資産課税制度の見直し

(1) 設備投資に関する減税

デジタル技術を活用して企業変革を進めることを目的として創設されました D X

(デジタルトランスフォーメーション) 投資促進税制は、投資を行う企業の後押しをする制度ではありますが、2年間の時限措置であるにもかかわらずデジタル要件と企業変革要件を満たした事業適応計画を提出しなければならないなど高い認定要件が必要となっております。さらに、認定後は「実施状況報告書」の提出も求められます。

また、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、民間企業の脱炭素化投資を加速するため創設されたCN（カーボンニュートラル）税制につきましても同様に中長期環境適応計画の策定と認定が必要であり、導入後には目標達成の根拠資料の提出が義務付けられた制度となっており、これら煩雑な手続きが本税制の利用を妨げております。

わが国のデジタル化、脱炭素化を加速するため適用、申請条件および事後報告などの事務手続きの撤廃を要望いたします。

近年わが国では、豪雨、地震、津波などの自然災害による甚大な被害が多発しており、事前対策の強化が求められています。これらに関連した設備投資に対する「中小企業防災・減災投資促進税制」が創設されておりますが、税額控除の適用はなく特別償却のみであり、取得前に計画の策定や認定を受ける必要があるなど使いづらい制度となっております。つきましては、手続きの簡素化や対象資産ならびに税制措置の拡充を希望します。

(2) 少額減価償却資産の取得価額引上げ及び一括償却資産の損金算入制度の廃止

現在、取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は即時償却が可能です。取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得した場合には、3年間の均等償却による損金算入の取り扱いとなっております。設備投資を促進するため、少額減価償却資産として損金算入できる金額を10万円未満から20万円未満に引上げ、取得価額20万円未満のものは使用時に全額損金算入が可能となるよう要望します。

また、中小企業者等に設けられています取得価額が30万円未満の少額減価償却資産の即時償却の特例について適用期限の撤廃とすべての企業へ適用可能となるよう制度の見直しをお願いします。

(3) 固定資産税（償却資産）の見直し

わが国における償却資産に関わる固定資産税について、国際的に見ても稀な制度であること、業種間での税負担に偏在があるなどの問題点を踏まえ、速やかな縮減と廃止を要望します。少なくとも、耐用年数の短い動産は、原材料・水道光熱費等の経費と同様、製品・部品を製造するために費消される投入原価要素であり、固定資産税の課税対象にはなじまないことから、課税対象から除外すべきと考えます。

償却資産にかかる固定資産税の申告には法人税の償却計算とは別に評価額の算出を要します。法人税と同一の償却計算にすることで申告作業の効率化に繋がっていただ

きますよう制度の見直しをお願いします。

5. 国際関連税制の見直し

(1) 移転価格税制の改善

移転価格調査の課税手法は取引単位営業利益法（TNMM）が一般的であるが、明確な数値が無く、企業側は法令違反を行っている訳では無いのに、当局による移転価格課税が行われる例が多くみられます。つきましては、国別業種別等の具体的な数値・基準等を法令等で明記して頂く事を要望します。

(2) 外国税額控除の条件緩和

企業活動がグローバルに展開される中で、二重課税の排除は可能な限り許容されるべきであります。当産業の企業の多くは海外に現地法人を設立し当該国/地域で活動を展開しておりますが、技術進歩が速いため国内からの人員派遣や設備貸与が不可欠となっております。日本企業がこれらの活動を通して現地で得る役務所得や設備使用料等は現地で源泉徴収課税された後に、現地法人や顧客から回収されますが、これら外国での課税額についての日本での外国税額控除の条件を見直し緩和することにより、企業のグローバルな活動促進が期待されます。

現行税制で3年間となっている控除限度超過額と控除余裕額の繰越期間を延長するとともに、繰越期間経過後の控除限度超過額を損金算入可能とする条件緩和により、二重課税の排除が拡大されることを要望します。

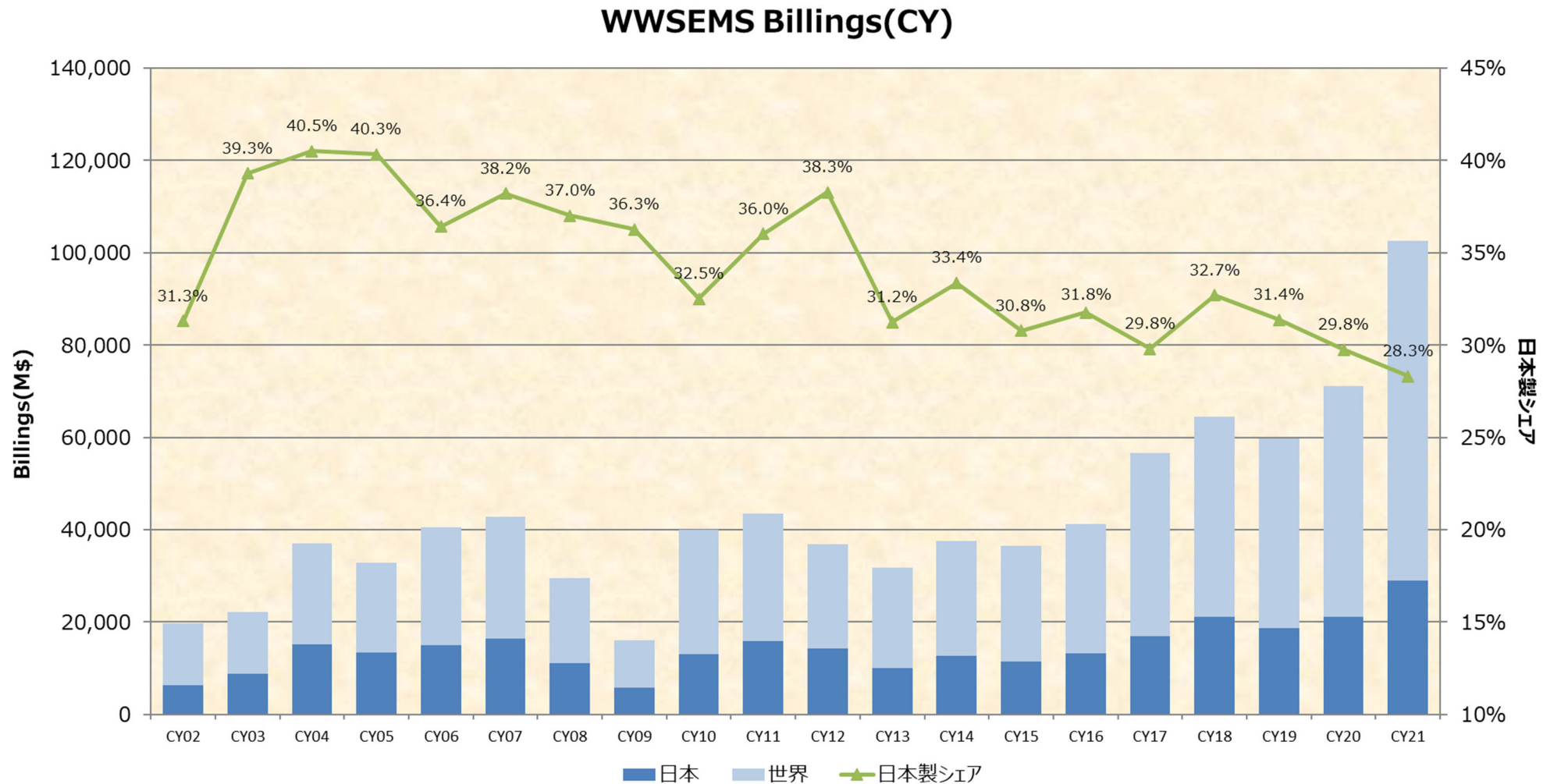
6. オープンイノベーション促進税制の継続と見直し

現行制度では、資本金の増加を伴う出資のみが適用対象ですが、既発行株式の取得でも対象に含めることを要望します。また、より深いシナジーが期待されるスタートアップ企業に対する既発行株式の取得を含むM&Aを行う場合においても、対象とするよう要望します。

以 上

＜添付資料 1＞

1. 半導体製造装置世界市場と日本製装置シェア推移

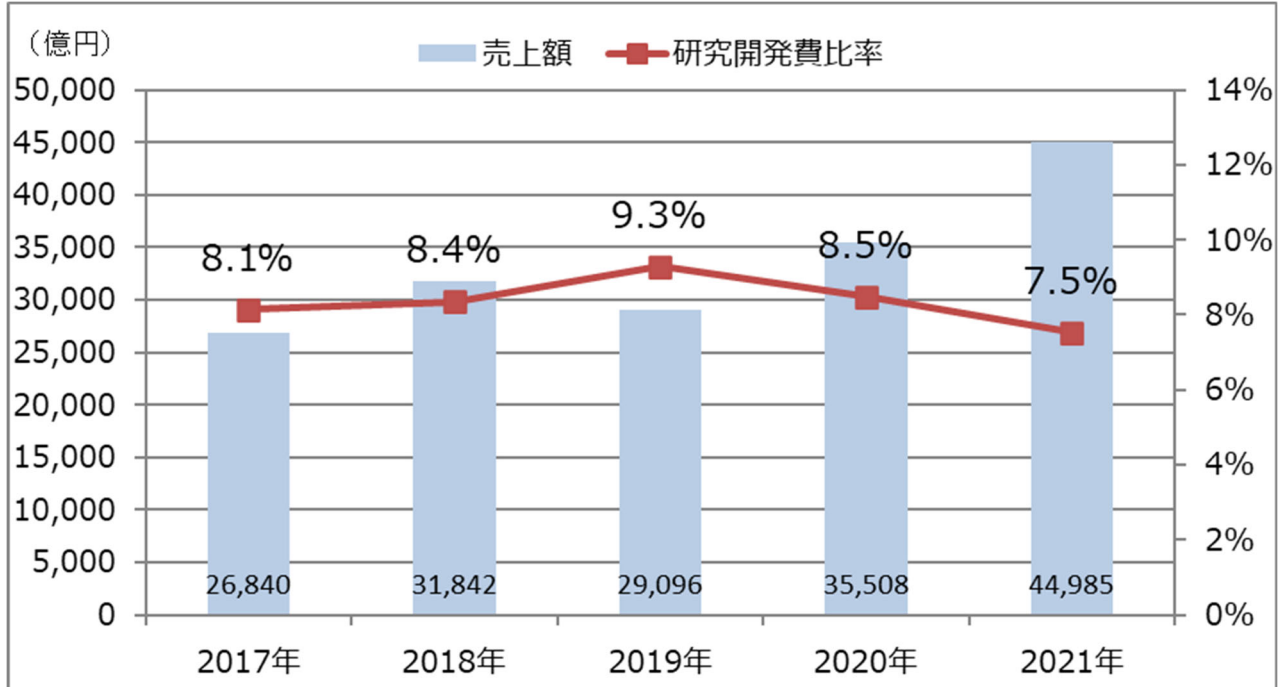


＜添付資料 2＞

2. 売上高研究開発費(事業)及び、設備投資(事業)比率

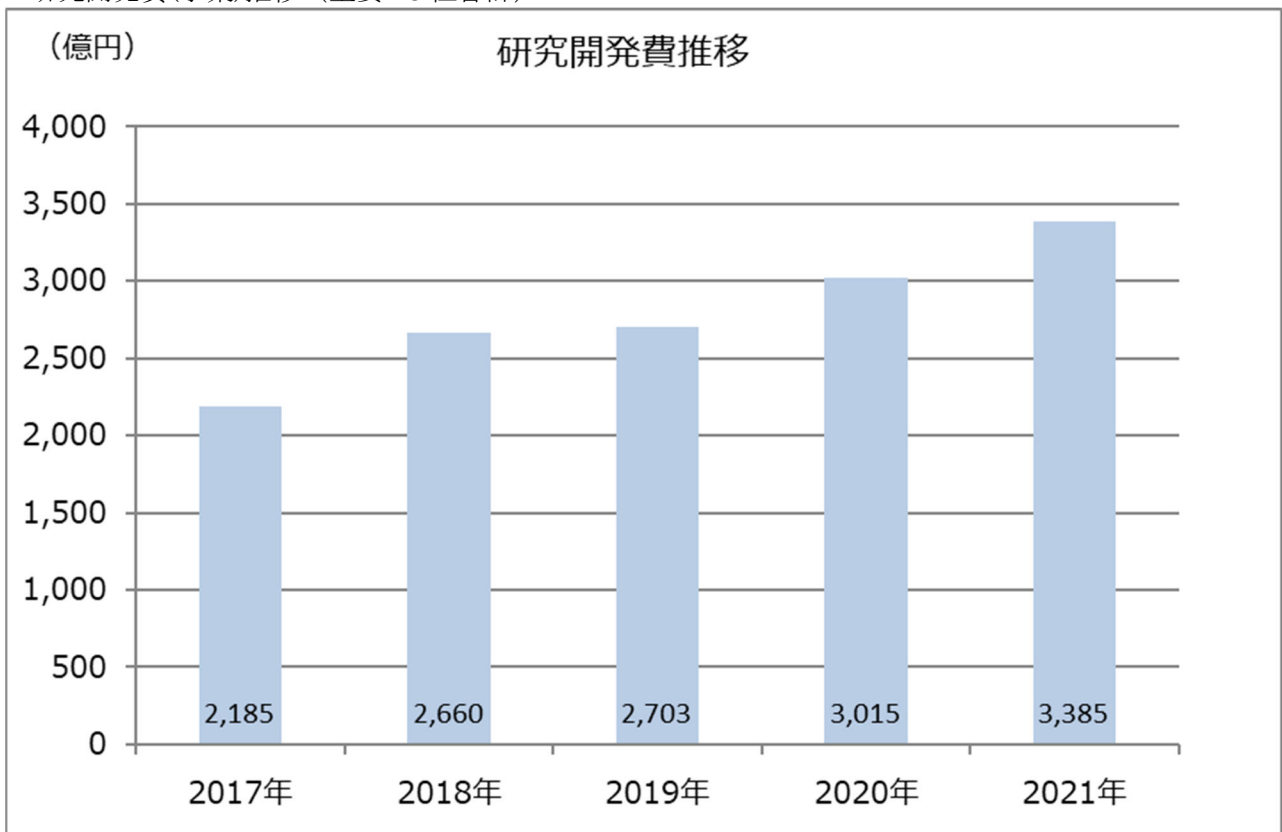
1) SEAJ 会員企業（主要 18 社合計）

＜売上高研究開発費（事業）比率（主要 18 社合計）＞

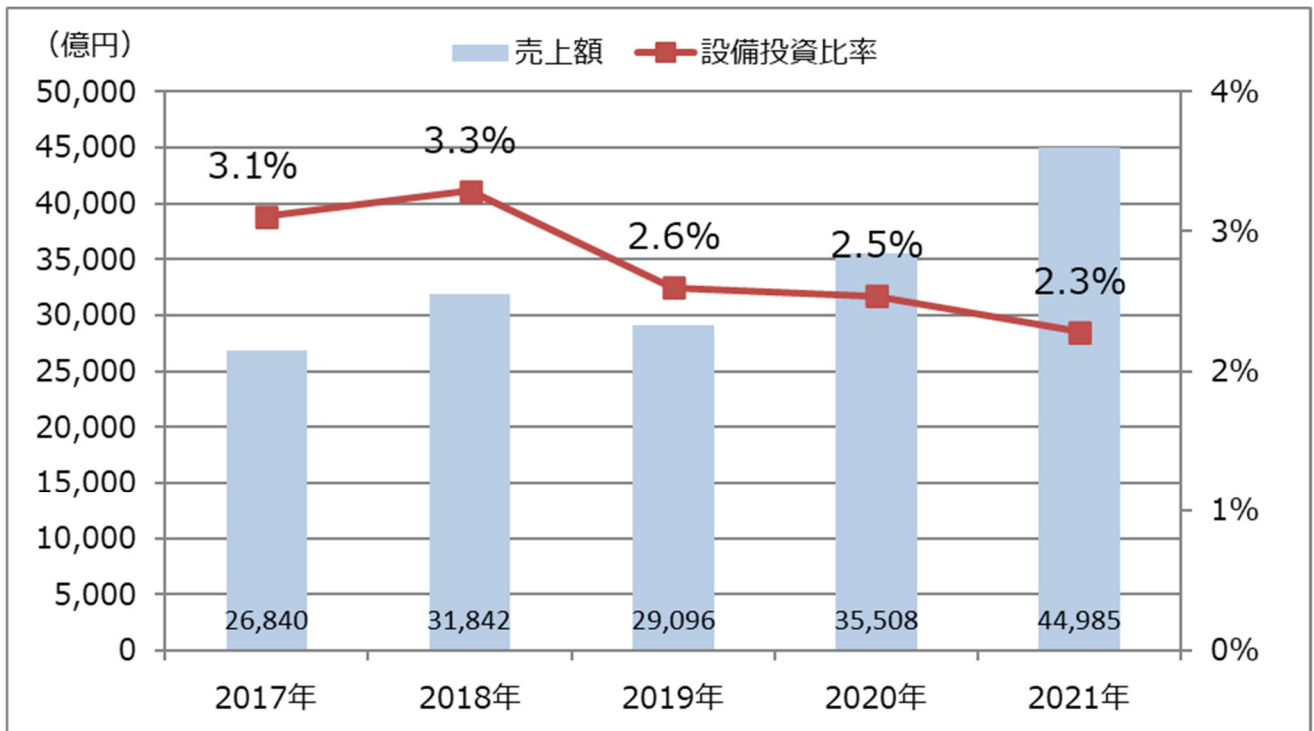


※2017 年～2021 年の 5 年間の平均売上高研究開発費比率 8.36%

＜研究開発費(事業)推移（主要 18 社合計）＞



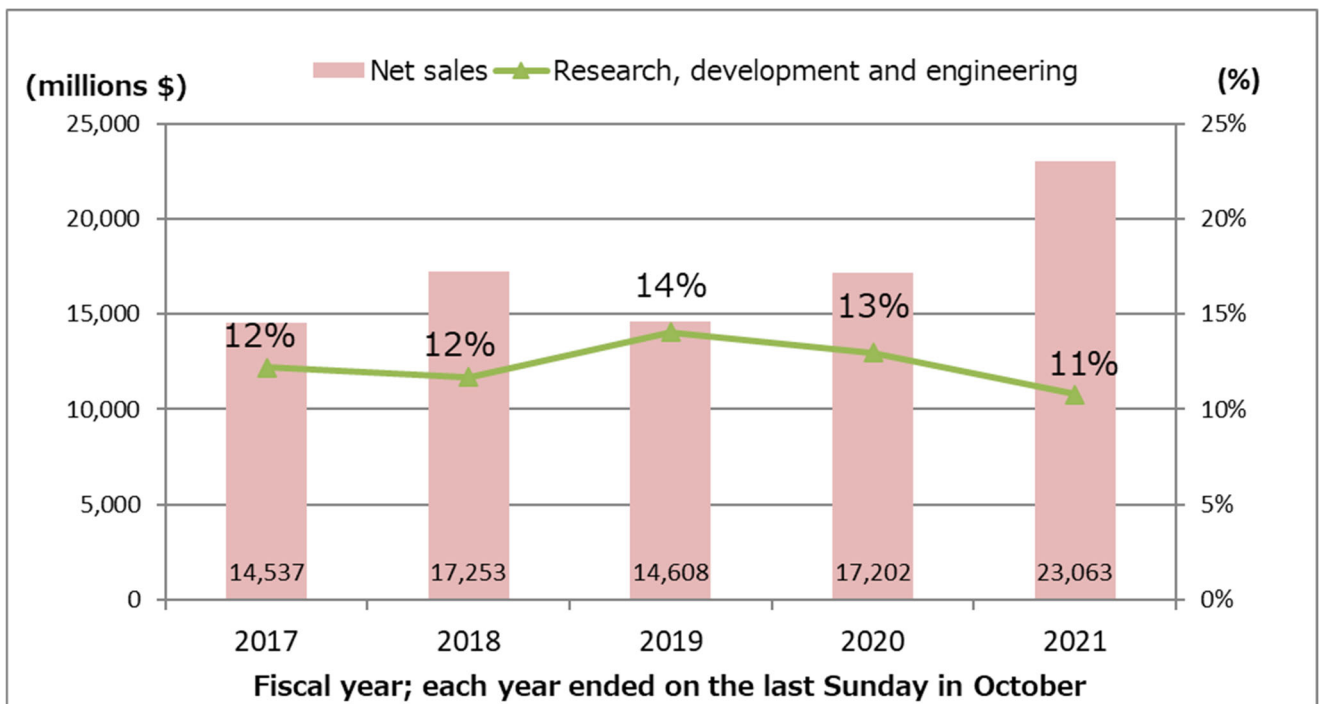
<売上高設備投資(事業)比率(主要18社合計)>



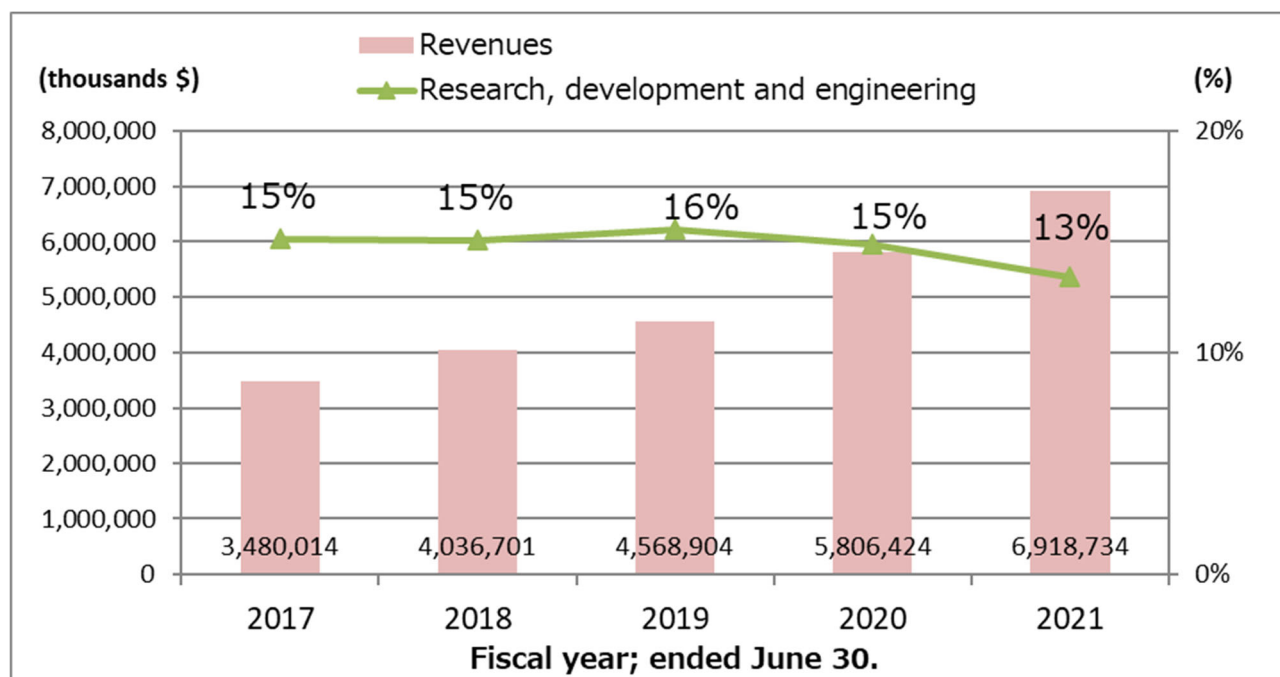
2) 海外競合企業(売上高研究開発費比率)

2017年～2021年の5年間の海外競合企業5社の平均売上高研究開発費比率 13.8%

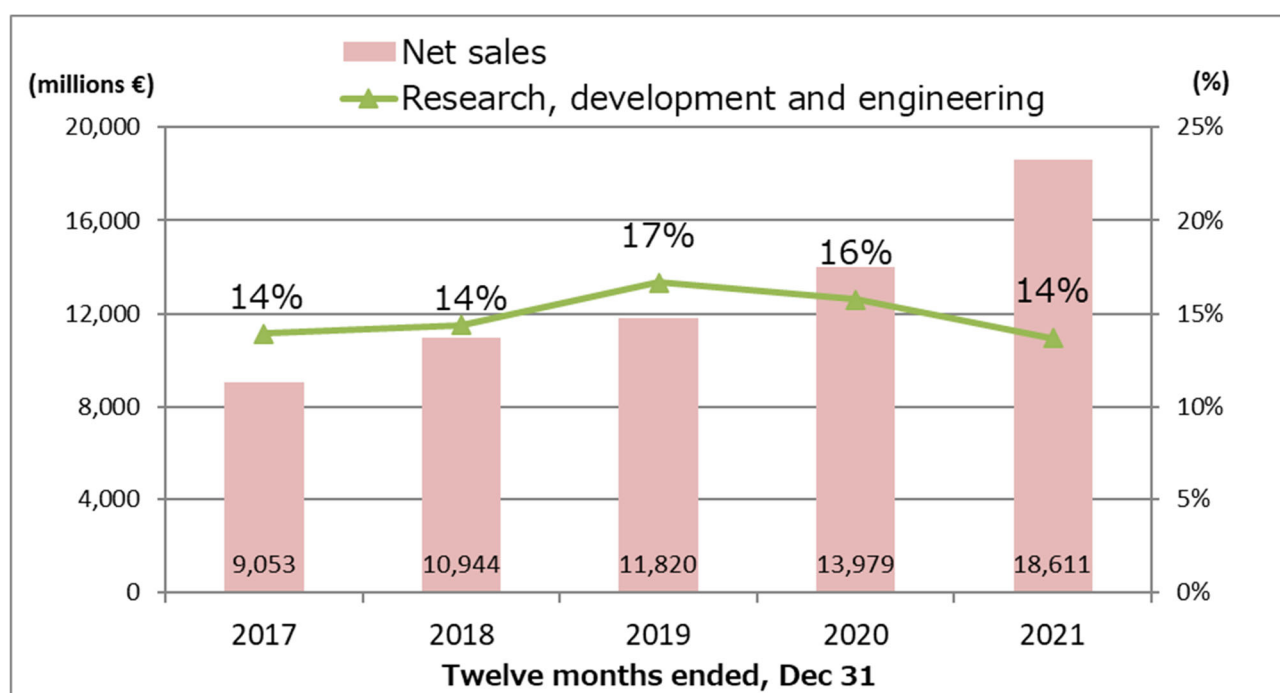
<AMAT>



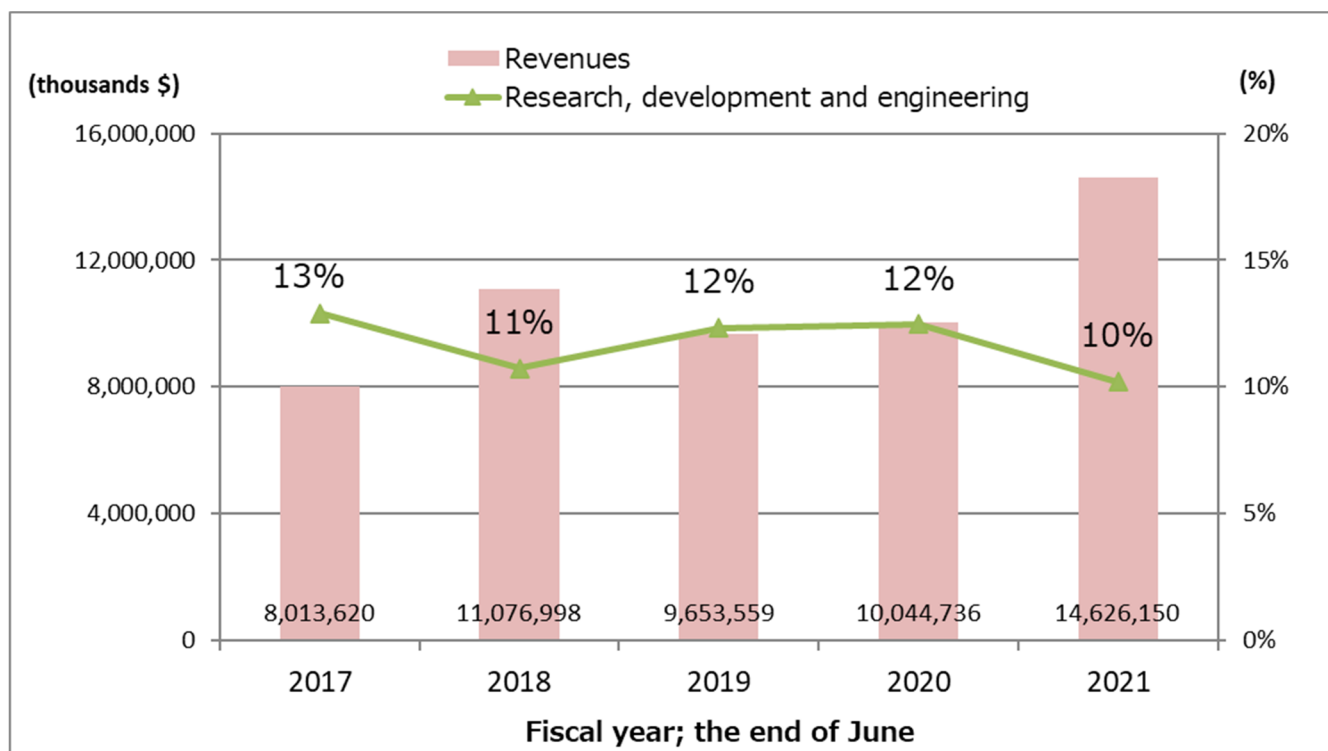
< KLA-Tencor >



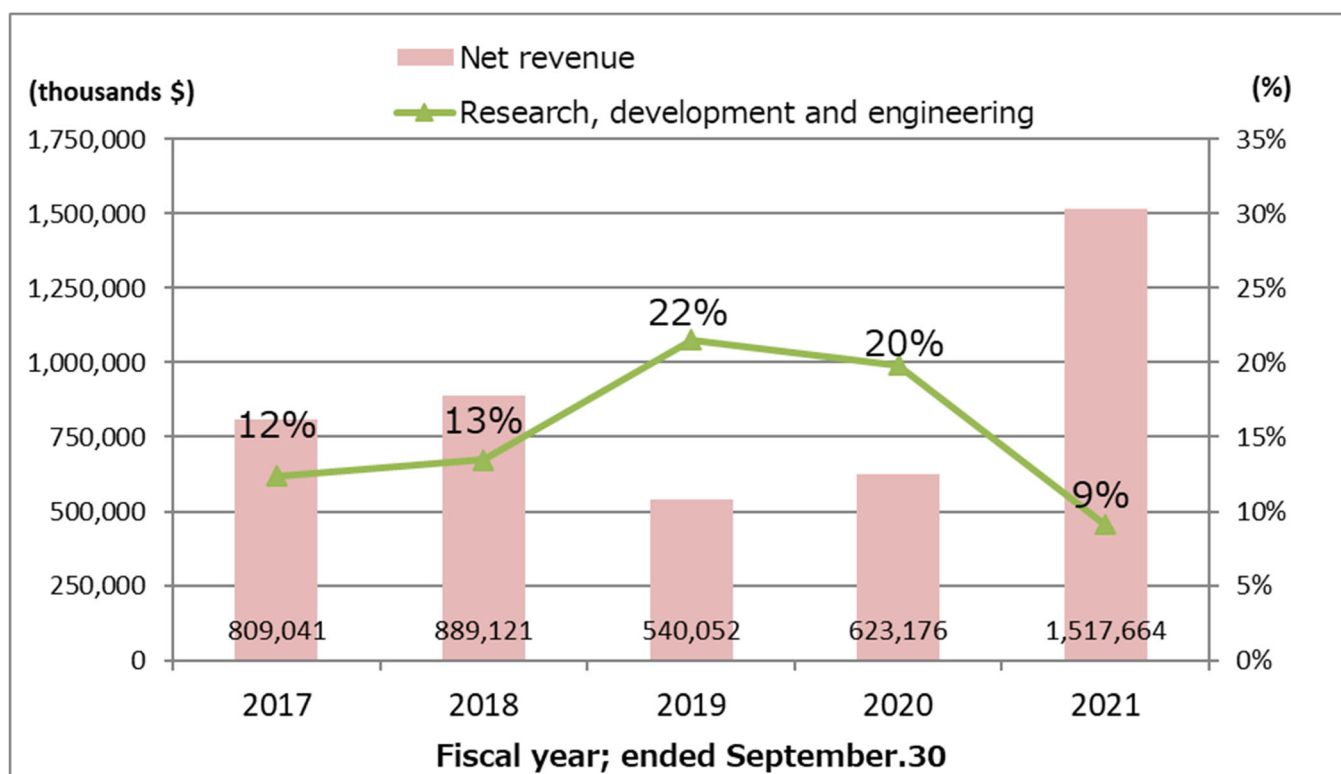
< ASML >



<Lam-Research>



<Kulicke & Soffa>



3) ASML 社法人税率推移 (2017 年度～2021 年度 平均 11.3%)

ASML (€ in millions)	2017	2018	2019	2020	2021
Net sales	9,053	10,944	11,820	13,979	18,611
Gross profit	4,077	5,029	5,280	6,797	9,809
R&D costs, net of credits	1,260	1,576	1,969	2,201	2,547
Selling, general and administrative	417	488	521	545	726
Income (loss) from operations	2,496	2,965	2,791	4,052	6,750
Income(loss) before income taxes	2,446	2,937	2,766	4,017	6,706
Provision for income taxes	327	345	174	463	822
Net income(loss)	2,119	2,592	2,592	3,554	5,883
法人税率	13.4%	11.8%	6.3%	11.5%	12.3%

4) AMAT 社法人税率推移 (2017 年度～2021 年度 平均 19.4%)

AMAT (millions \$)	2017	2018	2019	2020	2021
Net sales	14,537	17,253	14,608	17,202	23,063
Gross profit	6,532	7,817	6,368	7,692	10,914
R&D costs, net of credits	1,774	2,019	2,054	2,234	2,485
Selling, general and administrative	890	1,002	982	1,093	1,229
Income (loss) from operations	3,868	4,796	3,350	4,365	6,889
Income(loss) before income taxes	3,731	4,694	3,269	4,166	6,771
Provision for income taxes	297	1,381	563	547	883
Net income(loss)	3,434	3,313	2,706	3,619	5,888
法人税率	8.0%	29.4%	17.2%	13.1%	13.0%

5) 控除税枠切捨て額、繰越切捨て額 (SEAJ 会員企業主要 18 社合計)

(M¥)

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
売上額(全社)	8,383,354	8,734,834	7,996,918	7,697,671	9,642,105
研究開発費(会計上)	605,391	630,699	618,197	608,859	668,380
研究開発費(税務上)	448,400	483,883	501,792	503,815	553,768
法人税額	169,776	160,892	103,868	117,197	256,462
控除税額	36,284	39,850	25,896	29,038	47,884
税枠切捨て額 (注 2)	10,225	5,674	19,720	18,984	9,074

(注) 上記表に記載されている税務上の研究開発費、法人税額など税務上に関わる数値は法人税の別表を基に記載しています。

(注 2) 税枠切捨て額は試験研究費にかかる税額控除限度額が税額基準額を上回った集計となります。

6) 日本主要産業別研究開発費

(出所：経済産業省「2021 年企業活動基本調査確報－2020 年度実績－」)

	研究開発費 報告企業数	売上高 (百万円)	研究開発費 (百万円)	売上高研究 開発費比率 (%)	受託研究費 (百万円)	1 企業当たり(百万円)	
						売上高	研究開発費
合 計	8,344	340,223,089	14,538,293	4.3	702,449	40,775	1,742
製造業	6,133	220,127,649	12,069,146	5.5	300,279	35,892	1,967
電気・ガス業	48	23,304,282	132,408	0.6	14,641	485,506	2,758
情報通信業	636	18,580,884	507,312	2.7	56,525	29,215	797
卸売業	1,003	66,467,569	1,487,929	2.2	52,567	66,269	1,483
小売業	140	2,959,809	14,410	0.5	728	21,141	102
サービス業 (*)	130	X	X	X	23,703	X	X

(*) その他のサービス業を除く

(注) 売上高研究開発費比率=研究開発費/研究開発報告企業売上高×100

太字数値は、経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧－確報(データ) 2020 年企業活動基本調査確報－2019 年度実績－ 「第 1 巻 [研究開発に関する表] 第 10 表 産業別、企業数、売上高、研究開発費及び売上高比率、受託研究費、研究開発投資、能力開発費」より

7) 半導体・FPD 製造装置の設備投資額、償却資産残高推移

SEAJ 会員企業 (主要 18 社合計)

(M¥)

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
設備投資額(事業)	83,373	104,743	75,619	90,163	102,671
償却資産残高(機械設備等)	142,455	159,430	170,673	177,845	179,849